

平成 28 年 1 月 13 日

平成 27 年度 JIS 原案作成委員会 1
委員各位

一般社団法人 日本粉体工業技術協会
平成 27 年度 JIS 原案作成委員会 1
委員長 東谷 公

第 2 回 平成 27 年度 JIS 原案作成委員会 1
委員会開催のご案内
(ゼータ電位測定の方法 - 光学的方法)

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は、日本粉体工業技術協会の活動に種々ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、第 2 回委員会を下記にて開催致しますので、ご多忙中恐縮ですが、出席賜りますようお願い申し上げます。

出欠の連絡は 2 月 12 日（金）までに、下記連絡先にメールにてご連絡くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

日 時 : 平成 28 年 2 月 18 日（木）13:30～17:00
場 所 : 種苗会館 6 階 会議室（日本粉体工業技術協会 東京事務所階上）
最寄駅：東京メトロ丸の内線 本郷三丁目駅 徒歩 3 分
連絡先：（一社）日本粉体工業技術協会 東京事務所 大久保
〒113-0033 東京都文京区本郷 2-26-11 種苗会館 5 階
TEL : 03-3815-3955 email: okubo@appie.or.jp
議 題 : 素案審議

以上